



国家纳米科学中心

National Center for Nanoscience and Technology

研精闡微
為民關用
石各院

[首页](#) [单位概况](#) [人才队伍](#) [科研成果](#) [合作交流](#) [研究生教育](#) [党群建设](#) [科学传播](#) [仪器设备](#) [信息公开](#)

当前位置: [首页](#) > [科研成果](#)

科研成果

[> 论文](#)[> 专利](#)[> 标准](#)[> 专著](#)[> 获奖成果](#)

科研成果

一种低频BOSCH深硅刻蚀方法

| | |
|---|------------------|
| 专利名称: | 一种低频BOSCH深硅刻蚀方法 |
| 英文名称: | 一种低频BOSCH深硅刻蚀方法 |
| 专利类别: | 发明 |
| 申请号: | 201410720961.X |
| 申请日期: | 2014-12-2 |
| 授权日期: | 2017-5-17 |
| 专利号: | ZL201410720961.X |
| 第一发明人: | 徐丽华 |
| 其它发明人: | 褚卫国 |
| 专利授权日期: | 2017-5-17 |
| 关闭窗口 返回首页 | |

[理事单位](#) | [机构设置](#) | [挂靠单位](#) | [博士后流动站](#) | [招生咨询](#) | [主任信箱](#) | [违纪违法举报](#) | [友情链接](#)



中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

版权所有 © 2017-2018 国家纳米科学中心 京ICP备05064431号-1 京公网安备:

110402500013

地址: 北京市海淀区中关村北一条11号 邮编: 100190

电话: 010-62652116 传真: 010-62656765 Email: webmaster@nanoctr.cn

